# 高功率激光对激光同轴全息 测量粒子场的影响

刘振清,李作友,罗振雄,郑贤旭,叶 雁,钟 杰,李 军 (中国工程物理研究院流体物理研究所 109 室,四川绵阳 621900)

摘 要: 在激光同轴全息测量粒子场的实验中,经常使用的光学传像系统能起 到扩大工作距离和调整测试系统空间分辨率的作用。但是在利用高功率脉冲激光作 为照相光源时,经传像系统传像后的夫朗和费全息图上所记录的粒子中心出现了由 暗纹变成亮纹的反常现象。产生这种现象是由于激光经传像系统实焦点处聚焦击穿 空气产生等离子体,等离子体吸收物场的参考光,导致参考光无法到达干板上与物光 产生干涉。针对此问题提出了对传像系统实焦点抽真空的方案,解决了该问题,得到 了理想的全息图。

关键词: 高功率激光;同轴全息;粒子场;传像系统

## 1 引 言

脉冲激光同轴全息技术是测量高速运动粒子场的重要测试方法,能够获取微喷粒子的大小、形状、分布、速度及总质量等信息,具有测量精度高、图像直观、景深长、光路简单和获得的信息量大等 优点<sup>[1]</sup>。但由于粒子的高速运动,当用激光照射粒子场时,粒子在曝光时间内会产生位移,使生成 的全息图产生一定的动态模糊,最终导致粒子场的再现像出现相应的模糊,从而给粒子的判读带来 困难。所以为拍摄高速运动的粒子,要求曝光时间很短,才能保证粒子处于"冻结"状态(即相对静 止状态)。在一般的全息照相中,当粒子在曝光时间内移动的距离小于十分之一粒子直径时,通常 可以认为粒子处于"冻结"状态<sup>[2]</sup>,就可以忽略粒子的动态模糊。粒子的运动速度越低或激光的脉 宽越窄,粒子就越容易被"冻结"。因此,在测量高速粒子场的激光全息实验中,短脉冲激光器作为 照相光源被广泛的应用。

在实际工程应用中,为保护干板和方便实验,通常采用传像系统,将粒子场的信息转移到一定 距离外的全息干板上。同时传像系统还可以起到将粒子像进行一定程度的放大,以提高系统分辨 能力的作用。为了保证信息量的完整,该传像系统通常采用具有实焦点的凸镜组合系统。但在采 用高功率短脉冲激光器作为照相光源,同时使用传像系统开展全息实验时,全息干涉图的中心出现 由暗纹变成亮纹的反常现象,本文就该现象的产生进行分析和讨论,并提出有效的解决方法。

## 2 实验布局及现象

实验测试系统采用传统的同轴夫朗和费全息光路,光路图如图1所示。



© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

实验中,脉冲激光器输出的脉冲激光经扩束系统扩束后照射在粒子靶上,传像系统将粒子靶的 信息成像到全息干板上,被干板记录下来。实验中被照的目标物是 20 µm 左右的不同形状的光刻 粒子靶,它的原始图像如图 2 所示。使用纳秒激光器(功率密度约为 6×10<sup>10</sup> W/cm<sup>2</sup>)作为照相光源 时获得了如图 3 所示的正常全息图,图像背景灰度低,粒子对应的灰度高,光强分布均匀,记录下来 的粒子为白色的亮点,粒子场中间的十字线也为白色的亮线,其场分布为标准的夫朗和费全息场分 布。但当用皮秒激光器(功率密度约为 4×10<sup>12</sup> W/cm<sup>2</sup>)进行实验时得到的却是如图 4 所示的全息 图,该全息图上显示的背景灰度高,而粒子对应的灰度低,记录下来的粒子及十字线均变成了黑色, 光强也由当初的均匀分布变成了亮暗相间的圆环状分布,粒子的光强度分布与图 3 相比发生了突 变,出现了异常的现象。



图 2 粒子靶原始图像



图 3 使用纳秒激光器拍摄的粒子靶全息图

#### 3 现象分析和解决方案

全息照相是利用光的干涉原理,同时记录物光波的振幅和 位相信息。满足相干条件的两束光可以产生干涉,干涉条纹中 记录了物光的振幅和位相信息。因此,如果照相干板上除了接 收物光波外,还接收另一束未被物体扰动的参考光波,则物光波 和参考光波在照相干板平面上会发生干涉,产生干涉条纹,并且 被全息干板所记录,物光波的位相分布就包含在干涉条纹的分 布中<sup>[2]</sup>,通过对干板的处理再现,就得到全息图。可见全息照相 就是利用物光与参考光的干涉,从而记录下物光的全部信息。 而在同轴全息实验中,由于照明物体的光是平面波,到达全息干 板的光未被物体干扰仍是平面波,它就是参考光,照明光被物体 衍射的光就是物光。



图 4 使用皮秒激光器拍摄的 粒子靶全息图

在图 1 的实验中, 平行光通过粒子场时, 少部分激光被粒子 衍射成为物光, 未被扰动的激光继续向前传播成为参考光, 物光与参考光在全息干板处相干涉, 从 而记录下粒子靶的正常全息像。但是在激光功率较强的情况下, 由于平行光在通过传像系统第一 透镜的实焦点处要产生聚焦现象, 当聚焦区内光功率密度超过一定的阈值时(当激光脉宽大于 1 ns 时, 大气击穿阈值功率为 3. 2×10<sup>11</sup> W/cm<sup>2</sup>)<sup>[3]</sup>, 该区域内的空气将被迅速电离, 所产生的电子通过 逆轫致吸收激光能量, 这一过程最终导致内部高温高压的激光等离子体的产生。激光等离子体产 生的同时, 聚焦区域内还有明亮的火花和响声生成, 并且产生膨胀的冲击波向四周传播<sup>[4]</sup> 范围的爆炸现象称为空气光频击穿。击穿产生的等离子体吸收系数较大,其通过逆轫致吸收的形式大量吸收后续激光的能量<sup>[3]</sup>,结果导致参考光被吸收,无法到达接收面与物光产生干涉。因此在传像系统的后焦面接收的只是粒子的衍射像,因为被测粒子是不透光的,因此后焦面接收的相当于圆屏衍射图像,中心出现亮点(中心亮度最强),由于干板是负片,所以在干板接收的情况下成为黑点。当使用纳秒激光器作为照相光源时,由于纳秒激光器的功率相对较低,激光在通过传像系统时,能量不足以击穿空气,参考光与物光就能够顺利到达全息干板处产生干涉,粒子在干板上就会形成中心较亮的标准全息图。

要解决该问题只需要避免激光在经过传像系统时的空气击 穿现象即可。降低照明激光器的输出能量可以避免传像系统实 焦点处因功率密度过高导致的空气击穿现象,但会导致到达全 息干板的激光能量不足,从而影响全息图的线性接收。通过在 传像透镜组设计时采用没有实焦点的凹透镜系统可以避免空气 击穿,但凹透镜系统可能导致光信息的通过不足,最终导致物体 的细节信息丢失,影响实验系统的分辨能力。综合考虑,在激光 能量、波长、脉宽等参量不能改变的情况下,采用对传像系统进 行抽真空密封设计。因为激光击穿空气除了与激光光强、激光 频率、气体种类等元素有关外,还与气体的压强有直接关系。随 着气体压强的增加,气体的密度也随之增加,在同样的激光条件 下,光子被吸收的几率和电子与邻近中性分子的碰撞概率都要 增大<sup>[6]</sup>,从而空气被电离的概率也相应的增加。传像系统实焦 点处于真空状态,空气被击穿的阈值会大大提高。根据实验得



图 5 使用真空传像系统拍摄的 粒子靶全息图

到的数据,在其它条件不变的情况下,皮秒激光在传像系统后焦面发生空气击穿时的真空度的临界 点为 2500 Pa。实验时,传像系统中的真空度低于 2500 Pa 就不会发生空气击穿现象,参考光就可 以到达传像系统后焦面与物光产生干涉形成正常全息图。传像系统的抽真空密封设计对系统改动 不大,不会对系统参数产生任何影响。图 5 是使用真空传像系统(实验时真空度保持在 100 Pa 以 下)所获得的一张粒子靶全息图,图像背景灰度低,记录下来的粒子为白色亮点,对应的灰度高,与 使用纳秒激光器所拍摄的全息图的情况相一致,为标准的夫朗和费全息图,有效地解决了反常全息 图的问题。

#### 4 结 语

分析了在激光同轴全息实验中,高功率短脉冲激光通过传像透镜时因功率密度过高而击穿空 气,导致产生反常全息图的原因,并对产生机理进行了详细的分析,在此基础上提出对传像系统进 行抽真空密封设计。大量实验证明,能有效解决高功率短脉冲激光应用于全息照相时产生反常全 息图的问题,为高功率激光应用于同轴全息照相提供了技术基础。

### 参考文献:

- [1] 叶 雁, 郑贤旭. 用脉冲激光同轴全息技术测量微射流. 强激光与粒子束, 2004, 16(2): 159.
- [2] 刘子超,赵云惠. 液雾及颗粒的激光测量. 北京: 宇航出版社, 1988: 224-293.
- [3] Kroll N. Thoretical Study of Ionization of Air by Intense Pulses, Institute for Defense Analysis. Arlingon, VA: JASON 1970.

(下转第71页)

面因为底片本身具有曝光冗余度,另一方面也说明氙灯实际的电光转换效率应比计算中假设的 10 % 高。

#### 5 结 语

介绍了氙灯光源的特点与参数,采用两种计算方法计算高速摄影中所需要的氙灯光源参数及 氙灯光源提供的曝光量是否满足要求,第一种方法适用于摄影条件及摄影光路确定时,用于选择氙 灯光源的电气参数;第二种方法适用于氙灯光源确定时,推断其提供的曝光量是否能满足高速摄影 的需要。实验表明,利用文中列举的氙灯系统作为高速摄影实验的照明光源时,静态及动态实验均 得到较为清晰的图像。

#### 参考文献:

- [1] 谭显祥.光学高速摄影测试技术.北京:科学出版社,1992.
- [2] 谭显祥. 高速摄影技术. 北京: 原子能出版社, 1990.
- [3] 张三喜,姚 敏,孙卫平. 高速摄像及其应用技术. 北京: 国防工业出版社, 2006.
- [4] 张光升. 脉冲氙灯技术在高速摄影中的应用. 高能量密度物理, 2006, (1): 15-18.
- [5] 朱小清,林 翰. 照明技术手册. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [6] 罗贝尔, 杜伯华. 感光测定. 北京: 中国电影出版社, 1980.
- [7] Robert G Root, Paul Falkos. Plasma Discharge Replacement for Argon Candles. SPIE Conference on Highr Speed Imaging, 1999: 116- 126.

- [4] 钟 杰, 罗振雄. 非线性介质对粒子场同轴全息成像的影响. 强激光与粒子束, 2008, 20(10): 1729.
- [5] 张 平, 卞保民. 空气击穿过程中电子损耗对击穿阈值的影响. 激光技术, 2005, 29(5): 501.
- [6] 韩敬华, 冯国英. 纳秒激光脉冲在空气中聚焦的临界自由电子密度问题. 物理学报, 2008, 57(10): 6306.